

材料科學應用研討會 日立電子顯微鏡, 聚焦離子束及熱分析於缺陷分析的應用 HITACHI SEM、FIB and TA for Material Science Applications

微察秋毫、清水見石. 在講究證據的材料分析裡, SEM 的腳色就如同記者手中的相機, 掌握著細節與證據. 如何精準的取樣, 關係到證據是否可信, 以及真實性. 我們將透過實際分析案例的演示, 與您分享如何掌握分析的重點, 拍攝出一目了然的影像, 讓分析更全面, 不再如管中窺豹. 同時, HITACHI 新世代 FIB-SEM 也將於會中介紹, 讓分析多了無限的可能性.

熱分析是材料分析儀器的一個重要分支, 對物質的表徵發揮著不可替代的作用. 本次也將分享樣品的分析及應用. 最後是 HITACHI 新技術 EEM 螢光指紋圖譜的發表. 由外而內, 從外觀到本質, 本次研討會集合了應用人員的專業觀點及分析手法, 讓解析臻至完美!

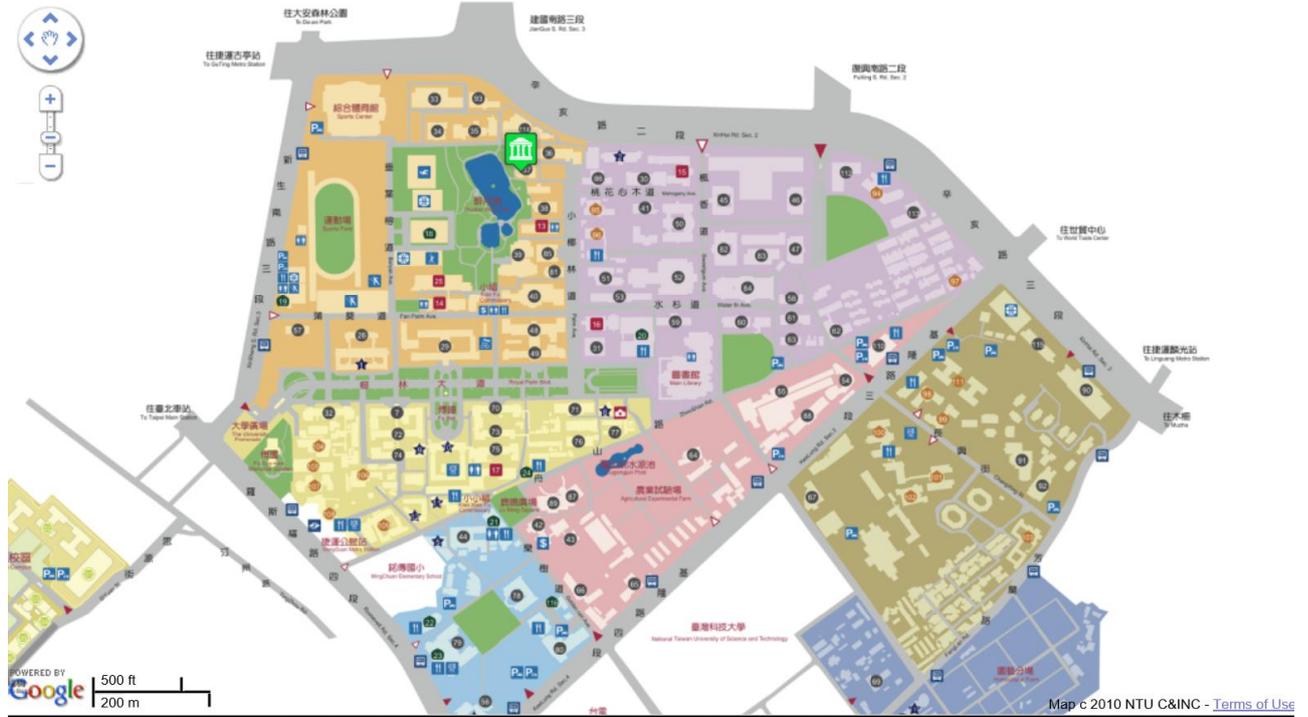
誠摯邀請 產學研究單位、材料分析實驗室、研發、品管、製程等相關從業人士

主辦單位：Hitachi High-Technologies Corporation 日立先端科技
Hitachi High-Tech Science Corporation 日立先端科學
E Hong Instruments Co. Ltd. 益弘儀器股份有限公司
協辦單位：國立台灣大學理學院貴重儀器中心

時間地點：108/10/17(四) 台灣大學理學院思亮館國際會議廳

時 間	流 程	主 講 者
09:00 – 09:30	報 到	
09:30 – 09:40	開場致辭	益弘儀器股份有限公司 董事長 李旺城 先生
09:40 – 10:30	FA 案例分析討論 I	益弘儀器 電顯部應用中心 郭瀚介 應用工程師
10:30 – 10:50	Tea Time	
10:50 – 11:40	熱分析樣品應用與經驗分享	日立先端科學 應用中心 下田瑛太 先生
11:40 – 13:00	Take a break	
13:00 – 14:00	FIB 基本介紹及應用	日立先端科技 分析市場部 李承憲 經理
14:10 – 14:50	螢光光譜結合影像在材料科學應用	日立先端科學 應用中心 岩谷有香 小姐
14:50 – 15:10	Tea Time	
15:10 – 16:00	FA 案例分析討論 II	益弘儀器 電顯部應用中心 陳柏智 應用工程師

台灣大學理學院思亮館國際會議廳



思亮館地址：Google Map 導航座標

報名方式：完全免費! 即日起受理報名(請於 10/9 前完成登記)
 ※詢問專線：台北(02)2755-2266#310 Kelly Hsu

日立電子顯微鏡, 聚焦離子束及熱分析於缺陷分析的應用研討會報名表

e-mail: kelly@ehong.com.tw			
我要報名參加○			
單位 姓名		電話 e-mail	
單位 姓名		電話 e-mail	
單位 姓名		電話 e-mail	